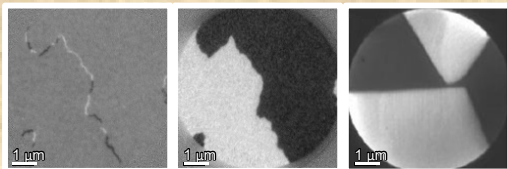


設備利用講習会

スピン偏極低エネルギー電子顕微鏡



ナノ領域の実時間3次元電子スピン解析
ELMITEC社 LEEM III
スピン偏極電子銃を搭載

ブロッホ 面内磁化 グラフェン
磁壁 ドメイン

日時: 2018年6月28日 13:00 - 17:00

場所: 物質材料研究機構 千現地区
研究本館8F中セミナー室(集合)

文部科学技術省ナノテクノロジープラットフォームNIMS微細構造解析プラットフォーム (Tel. 029-859-2310 nmcp@nims.go.jp <http://www.nims.go.jp/nmcp/>)より利用が公開されています上記顕微鏡の利用講習会を開催いたします。設備の利用方法と応用例について説明の後、実験室にて顕微鏡の操作・観察のデモを行います。奮ってご参加ください。

事前登録／問い合わせ

氏名、所属、Tel. を amc@nims.go.jp まで

国立研究開発法人物質・材料研究機構先端材料解析研究拠点
305-0047 つくば市千現1-2-1
Tel. 029-851-3354 ext. 3861
<http://www.nims.go.jp/amc/>